

| | | |
|-------|---|---|
| 発明の名称 | ニホウ化マグネシウムの製造方法(特許第 4752049 号) | |
| 学内発明者 | 櫻井 浩(理工学府) 尾池 弘美(理工学府) 高野 勝昌(元 SVBL) 他 | |
| 技術分野 | 半導体回路用材料 | IP16-063 |
| 発明の概要 | 低温でニホウ化マグネシウムを形成することにより、微細加工を安定して行うことを可能にするニホウ化マグネシウムの製造方法を提供する。 | |
| 説明図 | | 横軸にMgとBの各蒸着量から求めた原子比(Mg/B ₂ 比)をとり、縦軸に超伝導転移温度T _c をとった結果をプロットしたものの。 |
| ポイント | 100°C以下という比較的低温で、ニホウ化マグネシウム薄膜を形成することが可能になるため、有機材料の上にニホウ化マグネシウム薄膜を形成しても、有機材料が融解することがなく、リフトオフ法による微細加工を行うことが可能になる。従って、本発明により、半導体装置等の集積回路に、ニホウ化マグネシウム薄膜から成るデバイスを組み込むことが可能になる。 | |

| | | |
|-------|---|--|
| 発明の名称 | ばね型アクチュエータ及びその製造方法(特許第 4269058 号) | |
| 学内発明者 | 長屋 幸助(元工学研究科) | |
| 技術分野 | 機械アクチュエータ | IP16-088 |
| 発明の概要 | 構造が簡単で小型に構成することができるばね型アクチュエータ、及びばね型アクチュエータを小型に製造し得るばね型アクチュエータの製造方法。 | |
| 説明図 | | ばね型アクチュエータを駆動するための磁場発生コイルを示す断面図。 10: ばね型アクチュエータ 12: 圧縮コイルスプリング 14: 磁性体層 16: 磁性粉入接着剤層 18: スペース層 30、40: ばね型アクチュエータ 32: 減衰部材 42: 磁場発生 44、46: 永久磁石 48: 電磁石 |
| ポイント | 本発明は、コイルばねの復元力を利用して機械的な運動を生じさせるばね型アクチュエータに関する。 | |